PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-052267

(43) Date of publication of application: 26.02.1999

(51)Int.CI.

G02B 26/10 B41J 2/44 H04N 1/113

(21) Application number: 09-218211

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

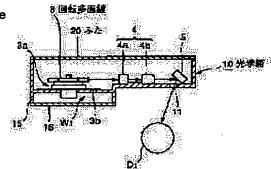
29.07.1997

(72)Inventor: SAIKAWA SHIZUKA

(54) LIGHT DEFLECTING SCANNER AND IMAGE FORMING DEVICE LOADED THEREWITH (57) Abstract:

from rising on the inside of an optical box. SOLUTION: By providing a projection part 15 having a void space at the bottom part of the optical box 10 and covering an aperture with a lower cover 16, an air course W1 is formed, and cool outside air is made to flow in the air course. The optical box 10 is cooled by the outside air flowing along a bottom wall. Thus, the heat radiation of a motor 3a rotating a rotary polygon mirror 3 and an IC for driving is accelerated and the temperature rise of an image—formation lens system 4 is prevented.

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent temperature



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平11-52267

(43)公開日 平成11年(1999)2月26日

(51) Int.Cl.*	識別記号	F I			
G02B 26/10		G 0 2 B	26/10	F	
B41J 2/44		B41J	3/00	D	
H 0 4 N 1/113		H04N	1/04	104A	

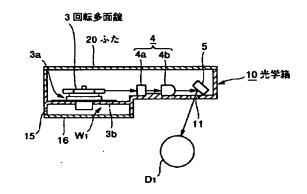
		審査請求	未請求 請求項の数7 FD	(全 7 頁)			
(21)出願番号	特願平 9-218211	(71)出顧人	000001007 キヤノン株式会社				
(22)出顧日	平成9年(1997)7月29日	(72)発明者	東京都大田区下丸子3丁目30番2号 寮川 静 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内				
		(74)代理人	弁理士 阪本 善朗				

(54) 【発明の名称】 光偏向走査装置およびこれを搭載する画像形成装置

(57)【要約】

【課題】 光学箱の内部が高温になるのを防ぐ。

【解決手段】 光学箱10の底部に空所を有する突出部 15を設けて、その開口を下蓋16によって塞ぐこと で、風路W1を形成し、ここに、冷たい外気を流動させ る。底壁に沿って流動する外気によって光学箱10を冷 却することで、回転多面鏡3を回転させるモータ3aや 駆動用IC3cの放熱を促進し、結像レンズ系4等の昇 温を防ぐ。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 光ピームを反射する回転多面鏡と、これ を回転駆動する駆動手段と、前記回転多面鏡を経て前記 光ビームを感光体に結像させる結像手段と、前記回転多 面鏡と前記駆動手段と前記結像手段を収容する光学箱 と、該光学箱の底部に空所を形成する空所形成手段と、 該空所形成手段の前記空所に外気を導入する開口手段を 有する光偏向走査装置。

【請求項2】 空所形成手段が、複数の互に独立した空 求項1記載の光偏向走査装置。

【請求項3】 開口手段が、空所形成手段の複数の空所 にそれぞれ個別に外気を導入するように構成されている ことを特徴とする請求項2記載の光偏向走査装置。

【請求項4】 空所形成手段が、空所を塞ぐ下蓋を備え ていることを特徴とする請求項1ないし3いずれか1項 記載の光偏向走査装置。

【請求項5】 空所形成手段が、光学箱の底壁に設けら れた凹所と、前記光学箱を載置する光学台によって構成 されていることを特徴とする請求項1ないし3いずれか 20 1 項記載の光偏向走査装置。

【請求項6】 請求項1ないし5いずれか1項記載の光 偏向走査装置と、これを支持する本体フレームを有する 画像形成装置。

【請求項7】 光偏向走査装置の近傍の雰囲気を流動さ せる送風手段を備えていることを特徴とする請求項6記 載の画像形成装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はレーザビームプリン 30 タやレーザファクシミリ等の画像形成装置に用いられる 光偏向走査装置およびこれを搭載する画像形成装置に関 するものである。

[0002]

【従来の技術】レーザビームプリンタやレーザファクシ ミリ等の画像形成装置に用いられる光偏向走査装置は、 高速回転する回転多面鏡によってレーザビーム (レーザ 光)等の光ビームを反射させてこれを偏向走査し、得ら れた走査光を回転ドラム上の感光体に結像させて静電潜 像を形成する。次いで、感光体の静電潜像を現像装置に 40 よってトナー像に顕像化し、これを記録紙等の記録媒体 に転写して定着装置へ送り、記録媒体上のトナーを加熱 定着させることで印刷 (プリント) が行なわれる。

【0003】図9は一従来例による光偏向走査装置を示 すもので、半導体レーザ101から発生されたレーザ光 Lo はコリメータレンズ101aによって平行化され、 シリンドリカルレンズ102によって線状の光束に集光 されて、回転多面鏡103の反射面に入射する。その反 射光は、回転多面鏡103の回転によって偏向走査され て、Y軸方向(主走査方向)の走査光となり、結像レン 50 ズ系104および折り返しミラー105を経て図10お よび図11に示す回転ドラムD。上の感光体に結像す る。感光体に結像する光東は、回転多面鏡103の回転

によるY軸方向の主走査と、回転ドラムDoの回転によ る2軸方向の副走査に伴なって静電潜像を形成する。

【0004】感光体の周辺には、感光体の表面を一様に 帯電する帯電装置、感光体の表面に形成される静電潜像 をトナー像に顕像化するための顕像化装置、前記トナー 像を記録紙等の記録媒体に転写する転写装置等が配置さ 所を形成するように構成されていることを特徴とする請 10 れており、これらの働きによって、半導体レーザ101 が発生する光東に対応する記録情報が記録紙等にプリン トされる。

> 【0005】回転多面鏡103の走査光は、その走査面 の一端に達したものがBDミラー106aによって反射 され、集光レンズ106bを経てBDセンサ106cに 導入され、処理回路107において走査開始信号に変換 されて半導体レーザ101に送信される。半導体レーザ 101は走査開始信号を受信したうえで、図示しないホ ストコンピュータから送信される画像情報に基づいた書 き込み変調を開始する。

> 【0006】半導体レーザ101やシリンドリカルレン ズ102、回転多面鏡103、結像レンズ系104等は 合成樹脂製の光学箱110の底壁に取り付けられる。回 転ドラムD。は光学箱110の外側に配設されており、 光学箱110の一端部には走査光を光学箱110から回 転ドラムDo に向かって取り出すための窓111が設け られている。

> 【0007】結像レンズ系104は、球面レンズ104 aとトーリックレンズ104bからなり、回転多面鏡1 03によって等角速度で走査される走査光を回転ドラム Do上においてY軸方向に等速度で走査する走査光に変 換するいわゆるfθ機能を有する。

> 【0008】光学箱110の上向きの関口は、光学箱1 10内に回転多面鏡103や結像レンズ系104、BD ミラー106a 等を組み付けたうえで、ふた120によ って閉塞される。

【0009】光学箱110を図10に示す光学台130 に対して組み付けるときには、まず、光学箱110の外 側の支持部112a, 112bに設けられたガイド穴に それぞれ係合する位置決めユニット113a, 113b の位置決めピン114a. 114b (位置決めピン11 4 a のみを図10および図11に示す) によって、光学 箱110のX軸方向 (光軸方向) と θ 軸方向 (回転角 度)の位置決めを行なう。X軸方向の位置決めは、両位 置決めピン114a, 114bをそれぞれ光学箱110 のガイド穴に対してX軸方向に同じ向きに移動させるこ とによって行なわれ、回転角度 θ (θ 軸方向の位置) は、両位置決めピン114a、114bをX軸方向に互 に逆向きに移動させることによって調整される。

【0010】このようにして感光体に対する相対位置を

調整したうえで、各位置決めユニット113a. 113 bを光学箱110に固定する。続いて、各位置決めピン 114a, 114bを光学台130の位置決め穴に係合 させ、図示しないビスによって光学箱110を光学台1 30に固定する。

【0011】回転多面鏡103を回転駆動するモータ1 03aは、モータ基板103bに実装された駆動用IC 103cと、該駆動用IC103cから供給される駆動 電流によって励磁されるステータおよびこれに対向する ロータ等からなる磁気回路によって構成される。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記従来 の技術によれば、回転多面鏡のモータが駆動されると、 モータ基板上の駆動用ICやモータのステータを構成す るコイルから発生する熱が光学箱内の雰囲気の温度を上 昇させる。このように光学箱の内部が高温になり、モー タを使用できる環境温度の限界を超えてしまうと、モー タの回転性能が劣化する。また、結像レンズ系等の光学 部品の光学性能が変化して、画質が著しく低下する。特 に、結像レンズ系等にプラスチックレンズを用いた場合 20 は、昇温によって屈折率が大きく変化するため、必要な レンズ性能を得られない。

【0013】加えて、近年ではレーザビームプリンタ等 の小型化が進み、図12に示すように光偏向走査装置E 。の極く近傍に定着器A。や排紙部B。等の発熱部が配 設される設計となっていることが多い。定着器A。は、 定着工程中には数百℃という高温になるため、これに光 偏向走査装置E。が近接していると、定着器A。の熱に よって光偏向走査装置E。全体が加熱される。また、定 着器A。を通過した記録紙等が排紙部B。にたまると、 定着器A。の温度よりは低いものの、排紙部B。からか なりの熱が光偏向走査装置E。に向かって放出され、光 学箱内の温度が上昇する。このように、外部の熱によっ て光学箱が加熱され、その結果、モータの回転性能が劣 化したり、結像レンズ系等の光学部品の光学性能が損わ れるおそれもある。

【0014】本発明は、上記従来の技術の有する未解決 の課題に鑑みてなされたものであり、運転中に光学箱の 内部が高温になるのを防ぎ、高性能でしかも安価な光偏 ることを目的とするものである。

[0015]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた めに本発明の光偏向走査装置は、光ビームを反射する回 転多面鏡と、これを回転駆動する駆動手段と、前記回転 多面鏡を経て前記光ビームを感光体に結像させる結像手 段と、前記回転多面鏡と前記駆動手段と前記結像手段を 収容する光学箱と、該光学箱の底部に空所を形成する空 所形成手段と、該空所形成手段の前記空所に外気を導入 する開口手段を有することを特徴とする。

【0016】空所形成手段が、複数の互に独立した空所 を形成するように構成されていてもよい。

【0017】開口手段が、空所形成手段の複数の空所に それぞれ個別に外気を導入するように構成されていると よい。

[0018]

【作用】光学箱の底部に沿って外気を流動させること で、光学箱の内部を冷却する。これによって、モータの コイルや駆動用IC等の放熱を促進し、結像手段等の光 10 学部品の昇温を防ぐことができる。

【0019】光学箱の内部が高温になってモータの回転 性能が損われたり、結像手段等の光学性能が劣化するの を回避して、画質性能を大幅に向上させることができ る。結像手段に安価なプラスチックレンズを用いても、 昇温による屈折率の変化を避けることができるため、光 偏向走査装置の低価格化にも貢献できる。

[0020]

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を図面に基づ いて説明する。

【0021】図1は第1の実施の形態による光偏向走査 装置を示すもので、半導体レーザ1から発生された光ビ **ームであるレーザ光L1 はコリメータレンズ1aによっ** て平行化され、シリンドリカルレンズ2によって線状の 光束に集光されて、回転多面鏡3の反射面に入射する。 その反射光は、回転多面鏡3の回転によって偏向走査さ れて、Y軸方向(主走査方向)の走査光となり、結像手 段である結像レンズ系4および折り返しミラー5を経て 図2に示す回転ドラムD:上の感光体に結像する。感光 体に結像する光束は、回転多面鏡3の回転によるY軸方 30 向の主走査と、回転ドラムD:の回転による Z 軸方向の 副走査に伴なって静電潜像を形成する。

【0022】感光体の周辺には、感光体の表面を一様に 帯電する帯電装置、感光体の表面に形成される静電潜像 をトナー像に顕像化するための顕像化装置、前記トナー 像を記録紙等の記録媒体に転写する転写装置等が配置さ れており、これらの働きによって、半導体レーザ1が発 生する光束に対応する記録情報が記録紙等にプリントさ れる。

【0023】回転多面鏡3の走査光は、その走査面の一 向走査装置およびこれを搭載する画像形成装置を提供す 40 端に達したものがBDミラー6aによって反射され、集 光レンズ6bを経てBDセンサ6cに導入され、図示し ない処理回路において走査開始信号に変換されて半導体 レーザ1に送信される。半導体レーザ1は走査開始信号 を受信したうえで、ホストコンピュータから送信される 画像情報に基づいた書き込み変調を開始する。

> 【0024】半導体レーザ1やシリンドリカルレンズ 2、回転多面鏡3、結像レンズ系4等は合成樹脂製の光 学箱10の底壁に取り付けられる。回転ドラムD」は光 学箱10の外側に配設されており、光学箱10の一端部 50 には走査光を光学箱10から回転ドラムD: に向かって

取り出すための窓11 (図2参照) が設けられている。 【0025】結像レンズ系4は、比較的安価なプラスチ ック製の球面レンズ4 a とトーリックレンズ4 b からな り、回転多面鏡3によって等角速度で走査される走査光 を回転ドラムD」上においてY軸方向に等速度で走査す る走査光に変換するいわゆる f θ機能を有する。

【0026】光学箱10の上向きの開口は、光学箱10 内に回転多面鏡3や結像レンズ系4、BDミラー6a等 を組み付けたうえで、図2に示すふた20によって閉塞 される。

【0027】光学箱10を図示しない光学台に対して組 み付けるときには、まず、光学箱10の外側の支持部1 2a, 12bに設けられたガイド穴にそれぞれ係合する 位置決めユニット13a、13bの位置決めピンによっ て、光学箱10のΧ軸方向(光軸方向)とθ軸方向(回 転角度) の位置決めを行なう。X軸方向の位置決めは、 両位置決めユニット13a、13bの位置決めピンをそ れぞれ光学箱10のガイド穴に対してX軸方向に同じ向 きに移動させることによって行なわれ、回転角度θ (θ 軸方向の位置)は、両位置決めユニット13a,13b 20 出す。 をX軸方向に互に逆向きに移動させることによって調整 される。

【0028】このようにして感光体に対する相対位置を 調整したうえで、各位置決めユニット13a, 13bを 光学箱10に固定する。続いて、各位置決めピンを図示 しない光学台の位置決め穴に係合させ、ビスによって光 学箱10を光学台に固定し、これを画像形成装置の本体 フレームに組み付ける。

【0029】回転多面鏡3を回転駆動する駆動手段であ るモータ3aは、モータ基板3bに実装された駆動用I 30 択し、放熱効果を狙う。 C3cと、該駆動用IC3cから供給される駆動電流に よって励磁されるステータおよびこれに対向するロータ 等からなる磁気回路によって構成される。

【0030】モータ3aが高速回転すると、光学箱10 内の雰囲気の温度がモータ3aの近傍から徐々に上昇し ていく。これは、モータ3aのステータを構成するコイ ルや駆動用IC3cの発熱によるものである。

【0031】また、光偏向走査装置の側傍には、図示し ない定着器が配設される。回転ドラムDiの感光体に転 ℃になり、このために、定着器近傍の雰囲気温度が急激 に上昇する。さらに、定着された記録紙が排紙部に積載 されると、排紙部周辺の温度も上昇する。

【0032】このように光偏向走査装置自体が、熱源で あるモータ3a等を含んでおり、また、定着器や排紙部 が近傍にあるため、光学箱10内の雰囲気の温度は、モ ータ3aの回転性能を劣化させたり、結像レンズ系4等 の光学性能を損うまでに髙温となってしまう。

【0033】そこで、光学箱10の底壁の下側に空所で ある風路W」を設けて、ここを流動する外気(空気)に 50

よって光学箱10の底壁を効率的かつ積極的に冷却し、 光学箱10内の昇温を防ぐ。詳しく説明すると、光学箱 10の底部に空所形成手段である中空の突出部15を設 け、これを下蓋16によって塞ぐことで、風路W1を形 成する。風路W』の一端は、図3に示すように光学箱1 0の一側部に開口しており、これと反対側の側部から外 側へ張り出す支持部12aには、開口手段である穴17 が設けられており、その近傍には、図示しないルーバー が配設される。このルーバーを通して光学箱10の外側 10 から新鮮な冷たい空気が穴17に送られてくる。穴17 に送られた冷たい空気は、光学箱10の底壁の下側を流 動し、モータ3aや駆動用IC3cを冷却する。

【0034】風路W1の角部および隅部は丸みをつけた 滑らかな形状となっており、光学箱10の外側に設けら れた送風手段であるファンF1により、穴17からの新 鮮な冷たい空気を風路W1 に吸引し、効率よく確実にモ ータ3a等を冷却する。この時の空気は矢印Cで示すよ うに流動し、モータ3aや駆動用IC3cを集中的に冷 却したのち、光偏向走査装置の側傍に暖かい空気を吐き

【0035】このように、光学箱10の底壁の下に風路 Wiを設けてここに冷たい風を流すことで、光学箱10 の内部を冷却し、モータ 3 a や結像レンズ系 4 等の高温 に弱い部品の性能劣化を防ぐものである。

【0036】なお、下蓋16の材質については、定着器 等の外部装置からの熱の影響が大である場合には、定着 器等からの熱を遮断するために断熱効果のある樹脂を選 択する。逆に、定着器などの熱源が近傍になく、下蓋1 6と光学台との間に多少でも風路がある場合は板金を選

【0037】本実施の形態においては、風路Wiで温め られた空気をファンF」が光学箱10の側傍へ吐き出す ように構成されているが、逆に外の冷たい空気を吸い込 んで風路に直接的に新鮮な空気を送り込むタイプのファ ンを使用してもよい。

【0038】空気の吐き出し量を多くして冷却効果を高 めるためには、風路の断面積を大きくするのが効果的で あることは言うまでもない。

【0039】図4は第2の実施の形態による光偏向走査 写されたトナーを記録紙に定着させるときの温度は数百 40 装置を示す。これは、光学箱40の底部に、回転多面鏡 3のモータ3aの直下から結像レンズ系4の直下まで広 がる空所形成手段である突出部45を設け、その開口を 下蓋46によって塞ぐことで幅の広い風路W2 を形成し たものである。モータ3aと駆動用IC3cの近傍と、 結像レンズ系4の近傍を集中的に冷却できるという長所 を有する。

> 【0040】図5は第3の実施の形態による光偏向走査 装置を示す。これは、図4の装置と同様に、光学箱50 の底部に回転多面鏡3のモータ3aの直下から結像レン ズ系4の直下まで広がる空所形成手段である突出部55

7

を設け、その関口を下蓋56によって塞ぐことによって 形成された空所を、光学箱50の底壁から突出するリブ 50aによって一対の互に独立した風路W3に分割した ものである。大きな空所のままであると、外気が均一に 流動せずに光学箱50が充分に冷却されないおそれがあ り、また、光学箱50の剛性が不足して振動を発生する 原因となる。そこで、リブ50aを設けて空所を分割す るとともに、光学箱50の底部の剛性を強化する。

【0041】また、図6に示すように、光学箱50の一方の支持部52aには、一対の風路W3に個別に外気を 10流動させるための一対の閉口手段である孔57a,57bを設ける。図示しないファンによって、穴57a,57bから一対の風路W3に個別に外気を吸引し、モータ3aや結像レンズ系4等をそれぞれ極めて効率良く冷却することができる。

【0042】なお、図7に示すように、光学箱60の空 所の断面積が例えば光軸方向に拡大するように形成され た突出部65を設ければ、各風路W4を流動する外気の 流量を充分に増大することができる。

【0043】なお、光学箱の底部の空所の断面形状は、 略長方形に限らず、いかなる形状でもよい。

【0044】図8は第4の実施の形態による光偏向走査装置を示す。これは、光学箱70の底壁に下向きの凹所75を設けて、これと、光学箱70を固定する光学台80の間に風路Wsを形成させたものである。

【0045】光学箱70の底壁と光学台80の間には、通常1~2mm程度の隙間がある。ここから風路Ws内の外気が漏れるのを防ぐために、光学台80にリブ80aを設けるとよい。

[0046]

【発明の効果】本発明は上述のように構成されているので、以下に記載するような効果を奏する。

【0047】運転中の光学箱を効率良く冷却し、昇温に よってモータの回転性能が劣化したり、結像レンズ系等 の光学性能が損われるのを回避できる。 【0048】これによって画像形成装置の画質を大幅に向上させることができる。また、結像レンズ系に安価なプラスチックレンズを用いてもすぐれた光学性能を確保できるため、画像形成装置の低価格化にも貢献できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】第1の実施の形態による光偏向走査装置を示す 模式平面図である。

【図2】図1の装置を示す断面図である。

【図3】図1の光学箱を底面からみた平面図である。

(図4)第2の実施の形態による光偏向走査装置を示す 断面図である。

【図5】第3の実施の形態による光偏向走査装置を示す 断面図である。

【図6】図5の装置を示す平面図である。

【図7】 第3の実施の形態の一変形例を示す断面図である。

【図8】第4の実施の形態による光偏向走査装置を示す 立面図である。

【図9】一従来例を示す模式平面図である。

) 【図10】図9の装置を示す断面図である。

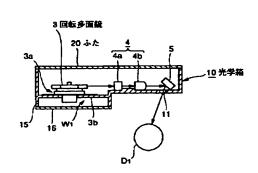
【図11】図9の装置を示す立面図である。

【図12】画像形成装置全体を説明する図である。

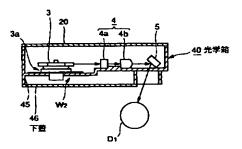
【符号の説明】

- 1 半導体レーザ
- 2 シリンドリカルレンズ
- 3 回転多面鏡
- 4 結像レンズ系
- 10, 40, 50, 60, 70 光学箱
- 15, 45, 55, 65 突出部
- 30 16, 46, 56 下蓋
 - 17, 57a, 57b 穴
 - 50a, 80a リブ
 - 75 凹所
 - 80 光学台

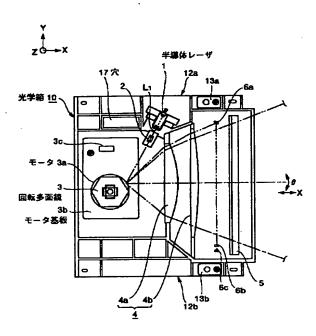
[図2]



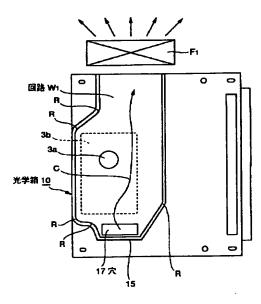
[図4]



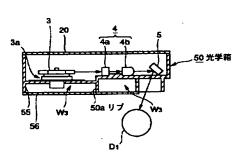
【図1】



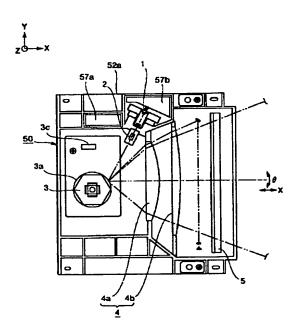
【図3】



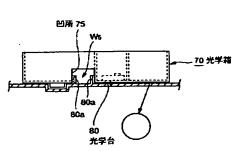
【図5】



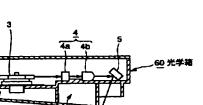
【図6】



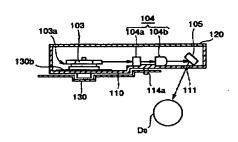
[図8]



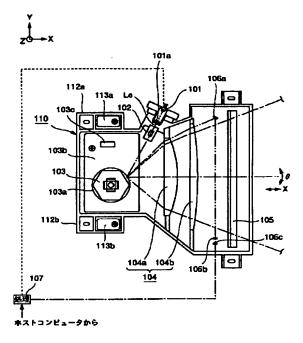
【図7】



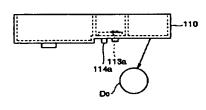
【図10】



【図9】



【図11】



【図12】

